

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

PCT

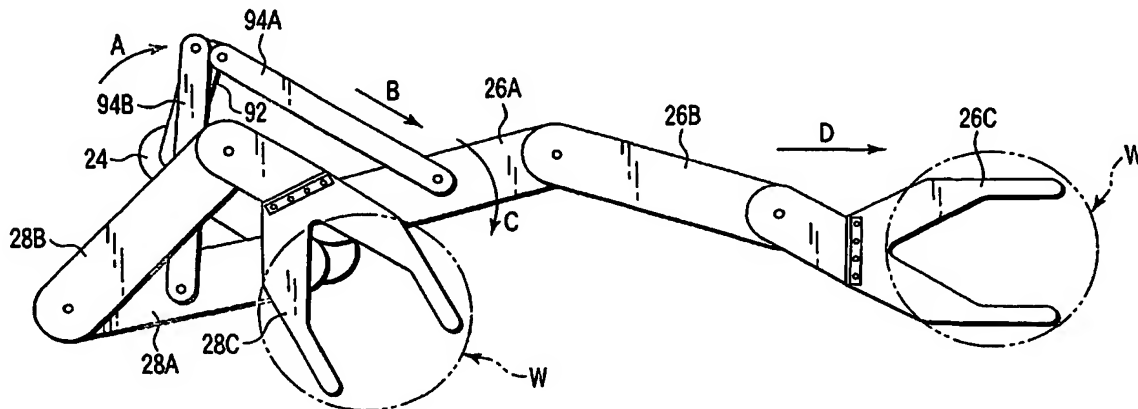
(10) 国際公開番号  
WO 2005/008769 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/68, (72) 発明者; および  
B25J 9/06, 13/08, B65G 49/07 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐伯 弘明 (SAEKI, Hiroaki) [JP/JP], 石沢 繁 (ISHIZAWA, Shigeru) [JP/JP], 新藤 健弘 (SHINDO, Takehiro) [JP/JP], 広木 勤 (HIROKI, Tsutomu) [JP/JP], 町山 弥 (MACHIYAMA, Wataru) [JP/JP].
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010178
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 9 日 (09.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-197689 2003 年 7 月 16 日 (16.07.2003) JP  
特願2004-009506 2004 年 1 月 16 日 (16.01.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許総合法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/ 続葉有 /

(54) Title: TRANSPORTATION APPARATUS AND DRIVE MECHANISM

(54) 発明の名称: 搬送装置及び駆動機構



(57) Abstract: A transportation apparatus (20) for a substrate (W) to be treated includes a rotatable base (24). Bendable/stretchable first and second arm mechanisms (26, 28) are installed on the rotatable base. The first and second arm mechanisms respectively have, in that order from the rotatable base side, base end arms (26A, 28A), intermediate arms (26B, 28B), and picks (26C, 28C) that are pivotably connected to each other. The picks are arranged so as to support the substrate to be treated. A link mechanism (30) is connected to the base end arms of the first and second arm mechanisms so as to drive the first and second arm mechanisms. A first drive source (32) for driving and rotating the rotatable base is provided. A second drive source (34) for driving the link mechanism so as to bend and stretch the first and second arm mechanisms is provided.

(57) 要約: 被処理基板 (W) の搬送装置 (20) は、回転可能な回転基台 (24) を含む。回転基台に屈伸可能な第 1 及び第 2 アーム機構 (26、28) が取り付けられる。第 1 及び第 2 アーム機構の夫々は、回転基台側から順に互いに旋回可能に連結された基端アーム (26A、28A) と中間アーム (26B、28B) とピック (26C、28C) とを有する。ピックは被処理基板を支持するように配設される。第 1 及び第 2 アーム機構を駆動するように第 1 及び第 2 アーム機構の基端アームにリンク機構 (30) が連結される。回転基台を回転駆動するため、第 1 駆動源 (32) が配設される。第 1 及び第 2 アーム機構を屈伸させるようにリンク機構を駆動するため、第 2 駆動源 (34) が配設される。

WO 2005/008769 A1

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, MI, MR, NI, SN, TD, TG).

### 一 國際調查報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。